

场发射扫描电子显微镜（SEM）

仪器基本信息	
仪器中文名	场发射扫描电子显微镜
仪器英文名	Field emission scanning electron microscope
仪器型号	ZEISS SUPRA® 55
生产厂家	德国 Carl Zeiss
工作状态	正常
	
主要技术指标	
分辨率	0.8 nm at 15 kV 1.6 nm at 1 kV
放大倍数	12 ~1,000kx
电子枪	热场发射型
探测电流	4 pA ~ 20 nA
加速电压	0.02 ~ 20kV, 10V 步进连续可调;
样品室	330mm (直径) × 270 mm (高);
样品台	5 轴电动样品台, X = 130mm, Y = 130mm, Z = 50mm, T = -3 到 70°, R=360° 连续
主要配置与附件	
能谱仪	Oxford X-Max 20 电制冷 X 射线能谱仪
探测器	In-Lens 探测器、角度选择背散射电子探测器(AsB)、SE2 探测器;
其他	Leica EM ACE200 全自动低真空镀膜系统 (喷金)
功能用途及样品要求	
功能及特点	对金属材料, 复合材料, 矿物材料, 陶瓷, 生物等材料进行表面微观形貌, 结构组织性能分析, 能谱成分分析
测样要求	测试样品必须为干燥固体、块状、片状、纤维状及粉末状均可。应有一定的化学、物理稳定性, 在真空中及电子束轰击下不会挥发或变形; 无磁性、放射性和腐蚀性。一般情况下, 样品尽量小块些 (≤ 10 x 10 x 5 mm 较方便)。纳米样品一般需超声波分散, 并镀导电膜。
联系方式	
仪器安放地点	深圳西丽大学城北大园区 G 栋 106
仪器负责人	南博文
联系电话	18535961899
Email	lanbw@pkusz.edu.cn
仪器预约与收费标准	
预约说明	接受校内 预约 , 校外预约请直接联系仪器负责人
收费说明	见 收费标准